

第17回国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム MEMS Green Innovation

大災害復興 節電に必須なMEMSグリーンイノベーション」～海外研究機関による最先端情報～

- 開催日時 2011年7月13日[水] 13:00-16:55
- 開催会場 東1ホール内 特設会場A
- 主 催 一般財団法人 マイクロマシンセンター

チェアマン： 東京大学教授/MEMS協議会 国際交流委員会委員長 下山 勲

講演資料集 ダウンロード方法： [ダウンロードを希望する講演タイトルをクリックしてください。](#)

■ オープニング	
13:00-13:05	開催挨拶 <div style="text-align: right;">(財)マイクロマシンセンター 理事長 作田 久男</div>
13:05-13:10	来賓挨拶 <div style="text-align: right;">経済産業省 製造産業局 産業機械課長 藤木俊光</div>
■ セッション1 大災害復興・節電に必須のMEMS Green Innovation	
13:10-13:40	Keynote MEMS Harsh Environment Sensors for Geothermal Power (Pdf:8.6MB) <div style="text-align: right;">Prof. Albert P. Pisano, University of California, Berkeley, U.S.A.</div>
■ セッション2 MEMSの未来応用・市場	
13:40-14:10	未来をひらく電磁メタマテリアル (Pdf: 4.7MB) <div style="text-align: right;">大阪大学 レーザーエネルギー学研究中心 教授 萩行 正憲</div>
14:10-14:40	Smart sensor MEMS for smart phone market (Pdf: 2.1MB) <div style="text-align: right;">Sam Guilaumé, CEO MOVEA, France</div>
14:40-15:10	MEMS市場と集積化MEMSの将来(Future prospect and applications of MEMS including integrated MEMS) (Pdf: 1.2MB) <div style="text-align: right;">IHSアイサプライ・ジャパン株式会社 南川 明</div>
15:10-15:20	休憩
■ セッション3 世界のMEMS研究所からの最新情報	
15:20-15:50	A New Perspective for CMOS MEMS R&BD and Manufacturing (Pdf:6.7MB) <div style="text-align: right;">Kwyro Lee, President National Nano Fab Center, Korea</div>
15:50-16:20	Development of sensors for bio medical and healthcare applications (Pdf: 2.6MB) <div style="text-align: right;">Dr. André Rouzaud, LETI, Deputy VP for microsystems and 3D, France</div>
16:20-16:50	N-MEMS prototyping facility for large scale production and the low power management by sensor network (Pdf: 2.1MB) <div style="text-align: right;">(独)産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター長 前田 龍太郎</div>
■ クロージング	
16:50-16:55	閉会挨拶 <div style="text-align: right;">(財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一</div>

※敬称略